

即時リリース

投資家向け広報窓口：

Ed Lockwood
インベスターリレーションズ部門シニアディレクター
(408) 875-9529
ed.lockwood@kla-tencor.com

メディア向け広報窓口：

Meggan Powers
コーポレートコミュニケーション部門シニアディレクター
(408) 875-8733
meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor が新しい欠陥検査および SEM レビュー装置を発表

*新しい電子ビームレビューと光学検査の結合により、
迅速な欠陥検出、特定、および原因究明を促進*

カリフォルニア州ミルピタス発(2013年7月8日)。 [KLA-Tencor Corporation](#) (NASDAQ:KLAC)は本日、 [NanoPoint™](#) テクノロジーと今回新しく発表された eDR™-7100 電子ビームウェーハ欠陥レビュー装置と共に、新しい光学ウェーハ欠陥検査プラットフォームである 2910 を発表しました。これらの2つのツールは、最先端デバイスでの欠陥の原因究明を促進することで IC メーカーのニーズに応じて、速度の向上とシームレスな接続を実現することで、歩留まりと信頼性を阻害する欠陥を迅速に検出し原因を特定します。2910 シリーズの欠陥捕捉率の向上と、eDR-7100 のレビュー分解能の強化は、3次元や FinFET などの垂直パターン構造の下層にある固有の欠陥を検出できることが実証されています。

「当社のお客様は、複雑なパターン形成手法を使用するプロセスを短時間で立ち上げる必要に迫られて、様々な欠陥の問題に直面しています。これらの問題を解決するために、当社は光学および電子ビームテクノロジーの技術革新を進めています。当社は、[NanoPoint](#) テクノロジーなどの新規の手法を通じて、光学検査の進化を続けています。これらのテクノロジーの進展によって、2910 シリーズでは光学検査の速度を維持しつつ、光学欠陥検出の能力を向上させることを実現しました。電子ビームテクノロジーのさらなる開発により、eDR-7100 では、他の電子ビームレビューツールには通常表示されないきわめて微小な欠陥を正確に特定することができます。これらのツールを組み合わせるとによって、最先端プロセスを評価するための効率が高い検査およびレビューソリューションをお客様に提供することができます。」と、KLA-Tencor のウェーハ検査グループ担当エグゼクティブ副社長 Bobby Bell は述べています。

2910 シリーズは、KLA-Tencor の特許取得済みの [NanoPoint](#) テクノロジーによって生み出される欠陥検出機能をベースにして、新しい光学アパーチャと検査モードを備えています。これらの新しい機能によって、ボイド、ブリッジ、ボトムブリッジなど、いくつかの歩留

まりにとって重大な問題を引き起こす欠陥の捕捉率を大幅に向上させられることが明らかになりました。さらに、旧世代の 2900 シリーズと比較して、2910 ではスループットが大幅に向上しています。そのため、エンジニアはより多くのウェーハをサンプリングすることが可能になり、プロセスレベルを精査することによって、歩留まり異常を迅速に特定することができます。

eDR-7100 には、第 4 世代の電子ビームイメージング光学系が搭載されており、分解能が向上しています。また、さまざまな欠陥タイプをイメージングするための追加のレビューモードが用意されています。特に、複雑なパターンや高アスペクト比の構造の底部にある欠陥を検出および特定できるというメリットがあります。これらの技術的進化により、eDR-7000 に比べてスループットの増強も実現しています。そのため、エンジニアは追加の欠陥をサンプリングして、ウェーハ上の欠陥集合をより正確に把握できます。IC ファブは、[Surfscan® SP3](#) などの検査装置で検出されたパターンなしウェーハ欠陥の電子ビームレビューをますます必要としているため、eDR-7100 は新しい光学顕微鏡とエネルギー分散型 X 線(EDX)による組成分析サブシステムを搭載して、欠陥の分類と特性評価を支援しています。

2910 または 2915 として構成された複数の 2910 シリーズ光学検査ツールと eDR-7100 電子ビームレビューツールが、先進の IC メーカーのサイトで設置され、新しい技術開発と立ち上げのために使用されています。ファブへの投資を確実に回収するために、2910 シリーズと eDR-7100 ツールは共に、旧世代の 2900 シリーズおよび eDR-7000 からそれぞれアップグレードできます。最先端の量産で要求される高い性能と生産性を維持するために、2910 シリーズおよび eDR-7100 ツールは [KLA-Tencor のグローバルで包括的なサービスネットワーク](#) によって支えられています。

2910 シリーズの光学検査装置の詳細については、[2900 シリーズの製品 Web ページ](#)を参照してください。eDR-7100 電子ビームレビューツールの詳細については、[eDR-7000 シリーズ製品の Web ページ](#)を参照してください。

KLA-Tencor について：

KLA-Tencor Corporation は、プロセス制御および歩留まり管理ソリューションにおけるリーディングカンパニーであり、検査および計測装置の最先端技術を提供するパートナーとして世界中のお客様に信頼されています。これらの技術は半導体、LED、その他の関連ナノエレクトロニクス業界で利用されています。業界標準の製品ポートフォリオと世界に誇る研究者チームによって、35 年以上にわたりお客様に優れたソリューションを提供してきました。KLA-Tencor は、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、世界中に販売およびサービス拠点が 있습니다。詳細については、<http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに記載されている過去の事例以外の事項、すなわち **eDR-7100** レビューツール、**2910** シリーズ検査装置、および **NanoPoint** テクノロジーに期待される性能、半導体業界における動向およびこれらに関連して予測される課題、**KLA-Tencor** の顧客により見込まれる **eDR-7100** レビューツール、**2910** シリーズ検査装置、および **NanoPoint** テクノロジーの用途、**eDR-7100** レビューツール、**2910** シリーズ検査装置、および **NanoPoint** テクノロジーの使用により実現可能な予想されるコストおよび運用上の利点およびその他の利点は将来の見通しであり、**Private Securities Litigation Reform Act of 1995**（1995年私募証券訴訟改革法）の **Safe Harbor**（セーフハーバー）条項が適用されます。これらの見通しは現時点での情報と予想によるものであり、多くのリスクと不確定要素を含んでいます。新技術の採用の遅延(コストまたは性能上の問題などの原因による)、競合他社による競合製品または代替技術の発売、当社製品の導入、性能、または使用に影響を及ぼす予期せぬ技術的な問題や限界など、さまざまな要因により、実際の結果はこれらの記述で予想された内容と著しく異なる場合があります。

###